



Daitron Wafer Prober System



本装置は光半導体ウェハの発光特性検査装置です。

Pulse または CW 駆動によりウェハ内のチップに対し電氣的及び光学的な測定が可能です。
LED デバイスから LiDAR 用途 LD デバイス測定に必要な光学測定を標準搭載しています。

Key features

- ▶ 各種特性データ取得を高速に取得
- ▶ デバイスに応じた通電方式及び測定環境を提供可能
- ▶ 非接触ウェハ搬送機構（ウェハ上面）
- ▶ 微小領域(Ith、Vth 付近)の詳細計測可能
- ▶ 高速・多ポイントの測定が可能（特性全般を msec オーダーで取得）

Applications

- ▶ Spot 測定 (I/V/P)
- ▶ Sweep 測定
- ▶ DC 測定 (Ir / Vr)
- ▶ 波長測定

Functions

- ▶ ウェハ&デバイスアライメント機能
- ▶ 連続エラー停止機能
- ▶ プローブ自動イニシャライズ機能
- ▶ 外周チップ未測定機能 他



計測アプリケーション画面 & マップ表示

Driver Lineup

Driver Line up	Current	Pulse Width
Standard Pulse Driver	~1A	50μsec ~

※ドライバは弊社ドライバラインナップよりカスタムオプションにて選択可能です。

Details

装置諸元	
・筐体寸法	~1700(W)×~1500(D)×~1950(H) mm
・ユーティリティ	単相 AC 200V±10% 30A(最大定格) 1 系統 空圧源：要（工場圧空）／ 真空源：要（真空ポンプ）
・重量	~1700kg（参考）
標準機能	
・対象デバイス（参考）	VCSEL Wafer / LED Wafer
・供給／収納形態	ウェハキャリアセット
・電流印加測定	1A（CW/Pulse）
・パルス幅	50μsec ~（設定単位 1μsec）
・パルス周期	5~19.9msec（設定単位 0.1msec） duty ~50%
・電圧印加測定	0~25V
・光出力測定	光学系または分光器仕様に依存
・波長範囲	分光器仕様に依存
・温度制御範囲	Option
・タクトタイム（参考）	0.7sec/chip ※測定条件によって変わります（メカ動作含む）
・安全機能	オープンショートチェック／フェイルチェック／通電安全チェック
測定機能	
・標準取得データ	Spot 測定：I / V / P
	Sweep 測定：I / V / P
	DC：Vr / Ir
	λ：λp / λd / λw（波長グラフ表示）
・オプション	温調機能
※その他計測項目に関してもご対応可能です。 ※Pulse 性能に関しては対象デバイス及びパッケージの影響に依存します。 ※デバイス治具・温調ステージ等もカスタム対応可能です。	

お問い合わせ先

ダイトロン株式会社 D&P カンパニー 計測機器工場 亀岡 営業担当
〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河 3-13-1
TEL 0771-24-1011(代) <https://www.daitron.co.jp>

製品ホームページ
(DWP-1200)



問い合わせ装置番号：DWP-1200